



半导体制造业中设备集成的理想之选！ 低硅测力传感器

在半导体的生产过程中，使用不易释放硅氧烷（由硅树脂所释放的气体）的设备至关重要。UWR是一种梁式测力传感器。考虑到会用在硅晶片周围，使用了不会产生氯气的氟树脂的绝缘线缆。



低硅树脂

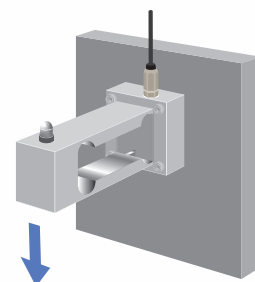
氟树脂线缆

技术参数

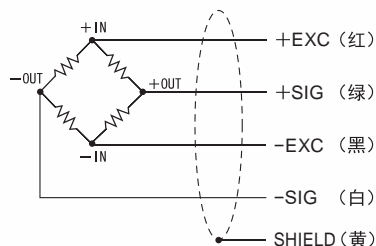
型号	UWR-10N
额定容量	10 N
额定输出	约 0.5 mV/V
允许负载	300% R.C.
零点平衡	±20% R.O.
非线性	0.03% R.O.
滞后性	0.03% R.O.
重复性	0.02% R.O.
补偿温度范围	0 ~ +50°C
允许温度范围	-10 ~ +70°C
零点的温度影响	0.5% R.O./10°C
输出的温度影响	0.2% R.O./10°C
输入端子间阻抗	约 1000 Ω
输出端子间阻抗	约 1000 Ω
推荐激励电压	5 V
绝缘阻抗(DC 50 V)	1000 MΩ 以上
电缆线	φ2 4芯氟树脂屏蔽线缆 3 m 头部散状
传感器材质	铝合金
RoHS指令	2011/65/EU (EU)2015/863

使用案例

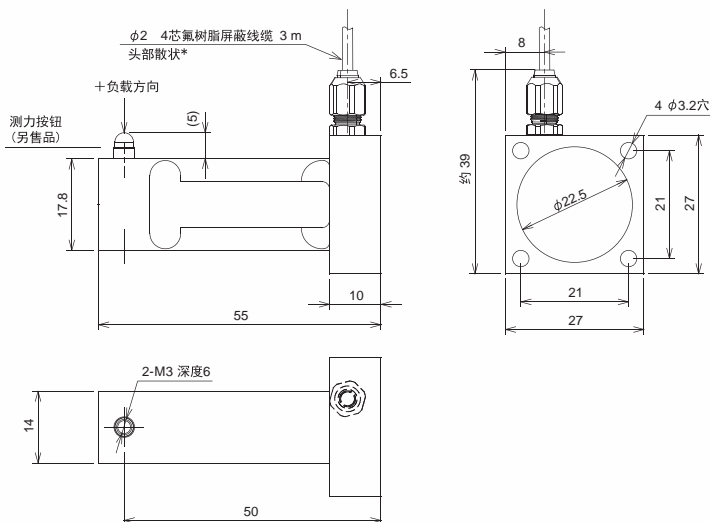
- 晶片传送机器人的夹紧力管理
- 晶片抛光过程中的压力控制
- 芯片贴装机的负载控制
- 焊线过程中的压力控制
- 气体、液体、胶状物等的附着力量



配线图



外形尺寸



型号	负载的弯曲	固有频率	重量
UWR-10N	0.04 mm	2.5 kHz	约 40 g

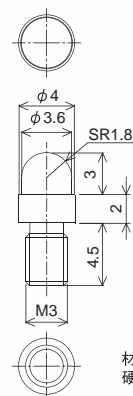
* 可提供线缆的接头加工，详情请向本公司咨询。

单位: mm

另售品

■ URM-LB

用于压力检测时的安装按钮



安装示意图



材质: 钢铁
硬度: HRC 50 以上